

## 高纯度Ptfе酸蒸清洗系统，痕量分析实验室器皿去污装置，采用防泄漏密闭回流技术及可定制多位容量

货号: PL-CP113



### 简介

利用这款高纯度PTFE酸蒸清洗系统优化痕量分析工作流程。该装置采用防泄漏闭环设计，可显著节省酸液并实现卓越的去污效果，这款可定制装置确保了用于敏感ICP-MS和ICP-OES实验室应用的超低背景水平。

[了解更多](#)

应用	描述	主要优势
痕量金属分析	去污用于ICP-MS和ICP-OES样品制备的TFM和PFA消解容器。	实现PPT和PPB检测的超低背景水平。
半导体制造	清洗PFA晶圆载具和流体处理组件，以去除痕量表面污染物。	防止高纯度制造过程中的金属污染。
地球化学研究	深度清洗用于矿物溶解和同位素分析的特氟龙坩埚和消解管。	确保敏感同位素和矿物学测量的高准确性。
环境监测	在重金属测试之前自动清洗大批量的土壤和水样容器。	在保持严格质量控制的同时提高实验室通量。
临床与制药	对用于敏感生物和药物代谢研究的PFA小瓶和移液管进行消毒。	消除敏感医疗样品批次之间的交叉污染。
核工程	去污用于分析放射性和腐蚀性材料的专用含氟聚合物实验室器皿。	为处理危险试剂提供安全、封闭的环境。

参数	PL-CP113 规格
产品货号	PL-CP113
主要结构材料	高纯度原生 PTFE / PFA
清洗机制	酸蒸回流 / 亚沸腾蒸汽清洗
兼容试剂	HNO <sub>3</sub> 、HCl、HF 及其他高纯度酸
处理能力	26个位置 (标准) / 完全可定制
密封方式	螺纹和垫片防泄漏密封
耐温性	连续运行最高至 200°C (受材料限制)
定制选项	腔室尺寸、架子几何形状和管径
控制系统	兼容外部PID温度控制器
制造工艺	端到端精密CNC制造